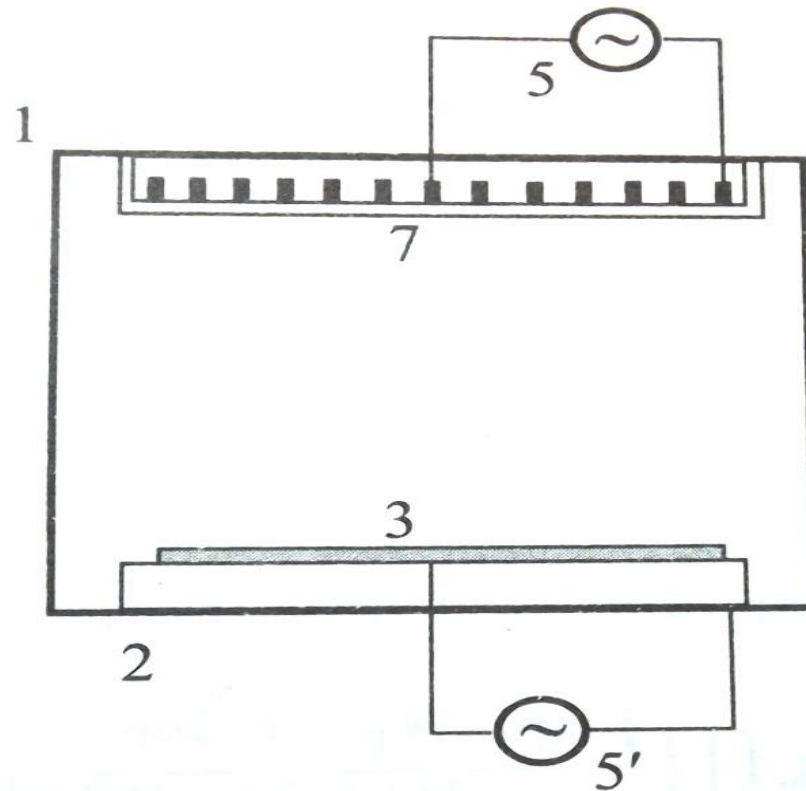


ПЛАЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ И ТРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

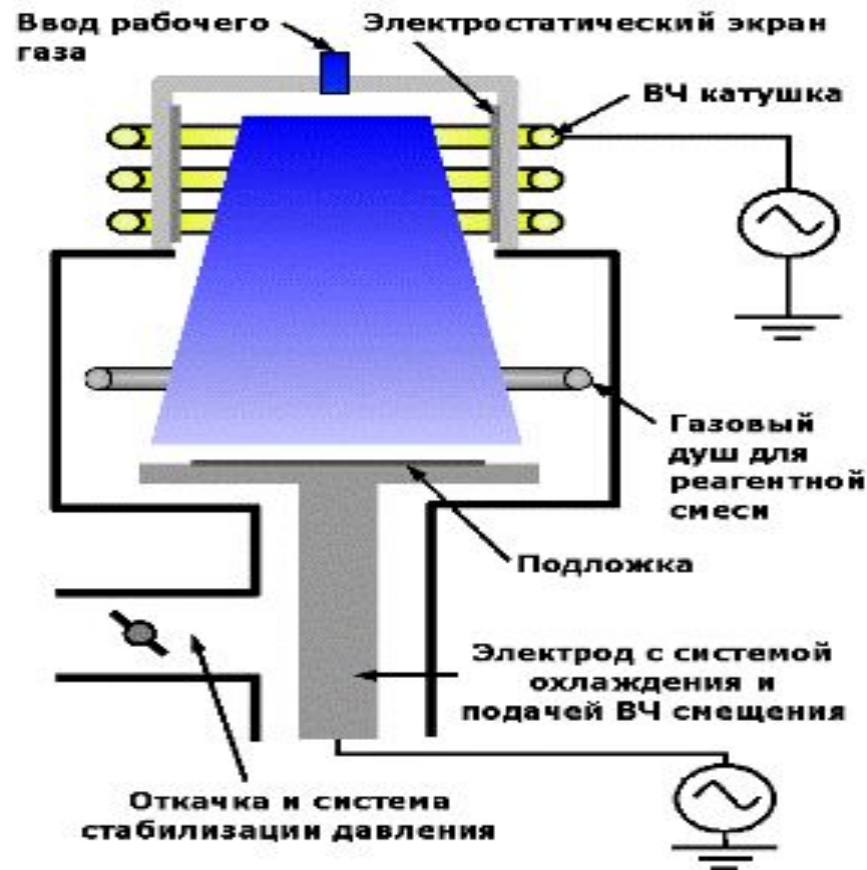
ЕГОРОВА О.П.

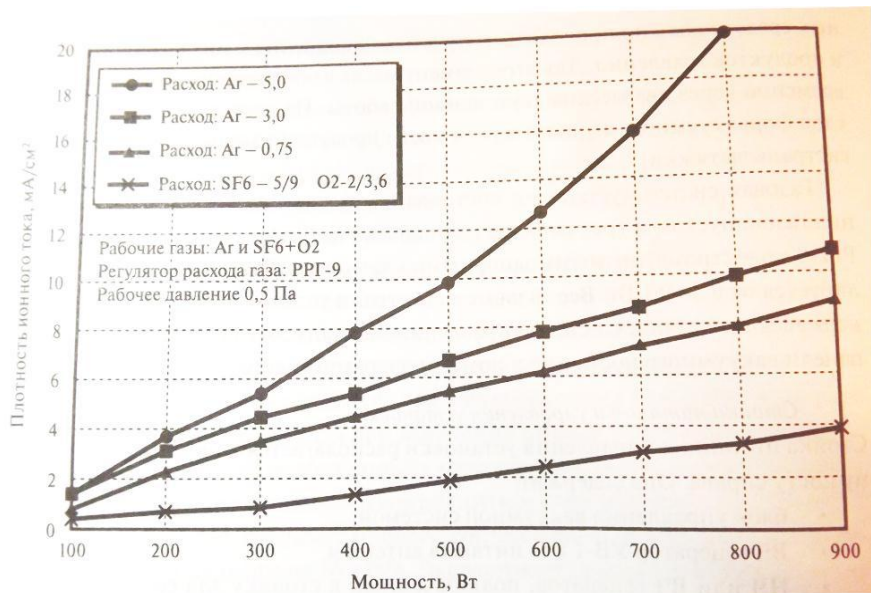
ИНДУКЦИОННО-СВЯЗАННАЯ ПЛАЗМА.



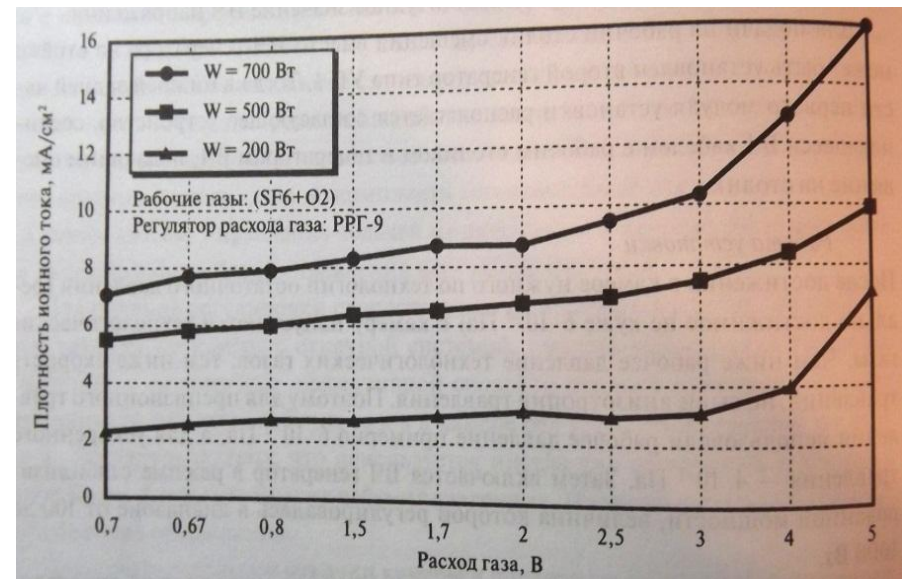
Индуктивный плазменный реактор
1 – вакуумная камера, 2 - активный электрод,
3 – обрабатываемая подложка, 4 – заземленный электрод, 5 – ВЧ-генератор.

СХЕМА РЕАКТИВНОГО ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ С ИСТОЧНИКОМ ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ **ICP ETCH.**





Плотность ионного тока в зависимости от мощности, подводимой к антенне



Плотность ионного тока в зависимости от расхода рабочего газа

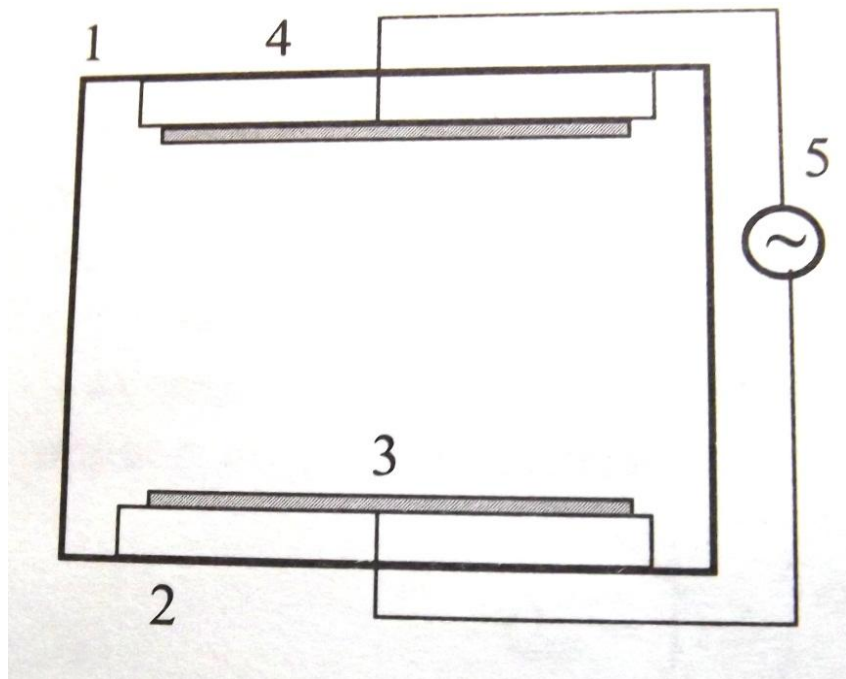


**Установка реактивно-ионного
травления в индуктивно-связанной
плазме ICP-RIE**



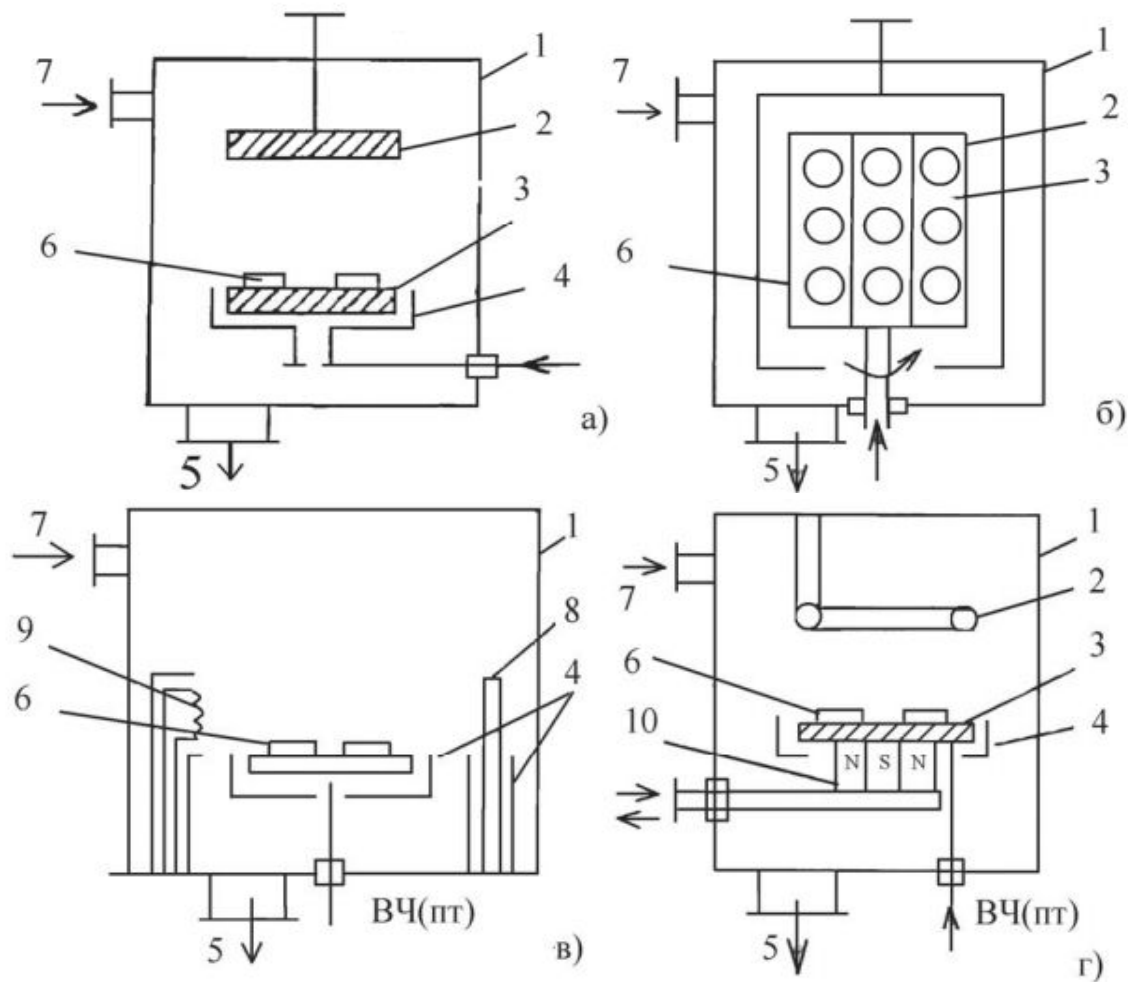
**Конструкция источника на
индуктивно-связанной плазме**

ПЛАЗМА ЕМКОСТНОГО РАЗРЯДА.



Емкостной реактор

1 – вакуумная камера, 2 - активный электрод,
3 – обрабатываемая подложка, 4 – заземленный электрод,
5 – ВЧ-генератор.



а – планарная ВЧ (ПТ)-диодная; б – вертикальная ВЧ (ПТ)-диодная с многогранным электродом; в – триодная; г – планарная магнетронная; 1 – камера; 2 – заземлённый электрод; 3 – ВЧ (ПТ)-электрод; 4 – заземлённый экран; 5 – откачка; 6 – обрабатываемые пластины; 7 – напуск газа; 8 – анод; 9 – термокатод; 10 – магнитная система.



Установка травления в плазме емкостного разряда STE RIE84